

После этого уравнение Пуассона принимает вид

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{\varphi - u_k}{L_D^2 \psi^2}. \quad (7.10)$$

Сравнивая это уравнение с уравнением (7.1), мы видим, что теперь длина экранирования равна

$$L_3 = L_D \psi, \quad (7.11)$$

где L_D — по-прежнему есть длина Дебая, определяемая формулой (7.2).

Положим, что выполняются неравенства

$$N_a \ll n_1, \quad n_0 \ll n_1. \quad (7.12)$$

Первое из них требует, чтобы концентрация компенсирующей примеси была достаточно мала. Второе неравенство, согласно формуле (7.4), обозначает, что доноры можно считать полностью ионизованными. Тогда $\psi \simeq 1$ и мы получаем рассмотренный раньше случай $L_3 = L_D$.

Другой крайний случай мы имеем, когда n_0 становится малым по сравнению с N_a . Это происходит, например, в компенсированных полупроводниках в области примесной проводимости при достаточном понижении температуры. Тогда уровень Ферми локализован вблизи уровня энергии доноров E_d (ср. § V.17), а следовательно, $n_1 \simeq n_0$ и

$$\psi^2 \simeq \frac{2n_0}{N_a + 3n_0}.$$

Если при этом концентрация электронов становится настолько малой, что $n_0 \ll N_a$, то

$$\psi^2 \simeq \frac{2n_0}{N_a}, \quad L_3^2 \simeq \frac{\epsilon kT}{2ne^2 N_a}. \quad (7.13)$$

В этих условиях длина экранирования перестает зависеть от концентрации свободных электронов, а определяется концентрацией компенсирующей примеси. Физический смысл этого результата заключается в том, что при неполной ионизации примесей объемный заряд, экранирующий электрическое поле, создается не только перераспределением электронов, но и пространственным изменением заряда примесей. При малом n_0 последний эффект становится главным.

§ 8. Обогащенный контактный слой в отсутствие тока

Рассмотрим теперь распределение потенциала в случае обогащенного контактного слоя ($e u_k < 0$ и в несколько раз превышает kT) (рис. 6.10). При этом удобно отдельно рассматривать область вблизи объемного заряда контакта 1 и остальную толщю полупроводника 2, где зоны можно считать уже неискривленными. В первом случае мы имеем

$$\exp \frac{e u_k}{kT} \ll \exp \frac{e \varphi}{kT} \quad (8.1)$$

и уравнение (6.11) упрощается:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{4\pi e}{\epsilon} n_k \exp \frac{e \varphi}{kT}.$$

Умножая обе части этого уравнения на $d\varphi/dx$ и интегрируя по φ , получаем

$$\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = \frac{8\pi n_k kT}{\varepsilon} \exp \frac{e\varphi}{kT} + C.$$

Постоянная интегрирования C определяется из условия, что на границе обеих областей

$$\varphi = u_k, \quad \frac{d\varphi}{dx} = 0.$$

Поэтому

$$C = -\frac{8\pi n_k kT}{\varepsilon} \exp \frac{eu_k}{kT}.$$

Отсюда видно, что, вследствие условия (8.1), для области вблизи контакта постоянной C можно пренебречь по сравнению с первым слагаемым. Поэтому

$$\frac{d\varphi}{dx} = \pm \left(\frac{8\pi n_k kT}{\varepsilon}\right)^{1/2} \exp \frac{e\varphi}{2kT}.$$

Так как мы рассматриваем обогащенный слой в электронном полупроводнике, то $\varphi < 0$ и увеличивается по абсолютной величине с увеличением x , а следовательно, нашей задаче соответствует знак минус. Интегрируя это уравнение еще раз по x в пределах от 0 до x , находим распределение потенциала в виде

$$-e\varphi = 2kT \ln \left(1 + \frac{x}{a}\right), \quad (8.2)$$

где a есть характеристическая длина:

$$a = \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi n_k e^2}\right)^{1/2}. \quad (8.3)$$

С точностью до множителя $2^{-1/2}$ это есть не что иное, как длина экранирования (7.2), в которой, однако, концентрация электронов в глубине образца n_0 заменена ее значением на контакте n_k . Таким образом, потенциал вблизи контакта изменяется по логарифмическому закону. Распределение концентрации электронов выражается соотношением

$$n = n_k \exp \frac{e\varphi}{kT} = n_k \left(\frac{a}{a+x}\right)^2. \quad (8.4)$$

Вдали от контакта (область 2)

$$\varphi = u_k, \quad n = n_k \exp \frac{eu_k}{kT} = n_0. \quad (8.5)$$

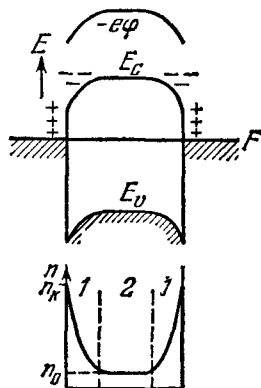


Рис. 6.10. Распределение электрического потенциала φ и концентрации электронов n в пластинке полупроводника с двумя металлическими контактами в отсутствие тока.

Распределение потенциала и концентрации электронов в слое полупроводника между двумя одинаковыми металлическими электродами с обогащенными слоями схематически показано на рис. 6.10.

Таким образом, прилегающие к металлическим электродам слои полупроводника, толщина которых $\sim a$, могут «заливаться» носителями заряда. При этом концентрация носителей вблизи контактов, как показывает формула (8.4), не зависит от их концентрации в глубине полупроводника n_0 , которая может быть как угодно мала (изолятор). Поэтому электропроводность слоистых (пленочных) структур металл — тонкий слой диэлектрика — металл (структура МДМ) может быть велика, даже если удельная электропроводность диэлектрика (в отсутствие контакта) ничтожно мала.

§ 9. Истощенный контактный слой

Рассмотрим теперь противоположный случай, когда приконтактный слой в полупроводнике обеднен основными носителями (запорный, или блокирующий, контакт). Мы ограничимся предельным случаем очень сильного обеднения, который особенно легко поддается расчету и в то же время часто встречается в практике.

Контакт металл—полупроводник. Положим, что к контакту приложено внешнее напряжение u , создающее обедненный слой. Если напряжение достаточно велико, то, следуя Шоттки, можно приближенно считать, что в некотором слое полупроводника толщиной d электронов нет вовсе («полностью истощенный слой»), так что объемный заряд обусловлен только заряженными донорами и акцепторами. В этом случае имеем $eu_k > 0$ (запорный слой), $\exp \frac{e(\varphi - u_k)}{kT} \ll 1$ и уравнение Пуассона (6.11) принимает простой вид:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{4\pi en_0}{\varepsilon} = \text{const.} \quad (9.1)$$

Интегрируя это уравнение два раза и принимая во внимание граничные условия (при d , подлежащем определению):

$$x=0: \quad \varphi=0; \quad x=d: \quad \varphi=u+u_k, \quad \frac{d\varphi}{dx}=0, \quad (9.2)$$

мы получаем

$$-\frac{d\varphi}{dx} = \mathcal{E} = -\frac{4\pi en_0}{\varepsilon} (d-x), \quad (9.3)$$

$$\varphi = u_k + u - \frac{2\pi en_0}{\varepsilon} (d-x)^2. \quad (9.4)$$

Полагая в формуле (9.4) $\varphi = 0$, $x = 0$, находим толщину запорного слоя:

$$d = \sqrt{\frac{\varepsilon(u_k + u)}{2\pi en_0}}. \quad (9.5)$$